

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-208996

(43)Date of publication of application : 03.08.2001

(51)Int.Cl.

G02B 26/10

B41J 2/44

H04N 1/113

(21)Application number : 2000-019371

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 27.01.2000

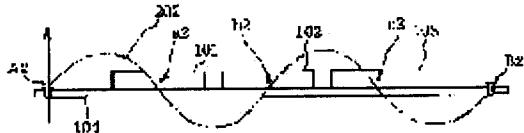
(72)Inventor : ITABASHI AKIHISA

(54) OPTICAL SCANNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent degradation of an image by preventing effectively the vibration of the deflector of a plurality of optical scanning modules arrayed on a substrate.

SOLUTION: In the optical scanner, where a plurality of optical scanning modules 101-103 which housed a light emitting source 1 and an optical system having a deflector 5 for deflecting and scanning repeatedly a light beam from this light emitting source 1 in the same holding frame body are arrayed on the same substrate 104, the deflector 5 is disposed at a position separated by a prescribed distance from the position used as the loop of the vibration at the time of the vibration of the substrate 104. The deflector 5 and also be disposed at the position which becomes the node of the vibration at the time of the vibration of the substrate 104, or near the node. The optical scanning modules 101-103 can also be asymmetrically arrayed on the substrate.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-208996

(P2001-208996A)

(43)公開日 平成13年8月3日 (2001.8.3)

(51)Int.Cl.⁷

G 0 2 B 26/10

B 4 1 J 2/44

H 0 4 N 1/113

識別記号

1 0 2

F I

テマコト^{*}(参考)

C 0 2 B 26/10

1 0 2 2 C 3 6 2

B 4 1 J 3/00

D 2 H 0 4 6

H 0 4 N 1/04

1 0 4 A 5 C 0 7 2

審査請求 未請求 請求項の数4 O.L (全6頁)

(21)出願番号

特願2000-19371(P2000-19371)

(22)出願日

平成12年1月27日 (2000.1.27)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 板橋 彰久

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
会社リコー内

Fターム(参考) 2C362 BA90 DA03 DA19

2H045 AA01 AA49 CA88 CA98 DA02

DA04 DA44

5C072 AA03 BA18 CA06 DA21 HA06

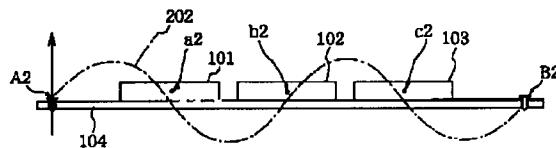
HA13

(54)【発明の名称】 光走査装置

(57)【要約】

【課題】 基板に配列された複数光走査モジュールの偏向器の振動を有効に防止して画像の劣化を防止する。

【解決手段】 本発明の光走査装置は、発光源1と、この発光源1からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器5を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュール101～103を同一の基板104の上に配列した光走査装置において、偏向器5は基板104の振動時における振動の腹となる位置から所定距離だけ離隔した位置に配置されている。なお、偏向器5は基板104の振動時における振動の節となる位置または節の近傍に配置してもよい。また、光走査モジュール101～103は基板の上に非対称に配列してもよい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記偏向器は前記基板の振動時における振動の腹となる位置から所定距離だけ離隔した位置に配置されていることを特徴とする光走査装置。

【請求項2】 発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記偏向器は前記基板の振動時における振動の節となる位置または節の近傍に配置されていることを特徴とする光走査装置。

【請求項3】 発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記光走査モジュールは基板の上に相互に非対称に配列されていることを特徴とする光走査装置。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1つの項に記載の光走査装置において、前記光走査モジュールは同一の基板の上に光ビームの走査方向を合わせて配列されていることを特徴とする光走査装置。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】 本発明は、プリンタ、デジタル複写機、デジタルファクシミリ装置あるいはデジタル印刷機などの画像形成装置に用いられる光走査装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来より、光走査装置は、デジタル複写機等の電子写真式画像形成装置の書込光学系として用いられている。従来の光走査装置が用いられた電子写真式画像形成装置は、メインモータを駆動源として定速で回転する感光体ドラムを備えている。この感光体ドラムの周囲には、チャージコロトロンと光走査装置と現像装置とトランスマカロトロンおよびクリーニング装置が配置されている。チャージコロトロンは、感光体ドラムの表面に電荷を一様に帯電する。光走査装置は、一様に帯電された感光体ドラムの表面に光ビーム（レーザービーム）を照射して静電潜像を形成する。現像装置は、感光体ドラムの表面に形成された静電潜像にトナーを与えて現像する。トランスマカロトロンは、現像後に感光体ドラムの表面に形成されたトナー像を用紙に転写する。クリーニング装置は、トナー像の転写後に感光体ドラムの表面に残っているトナーを回収する。クリーニング装置によって清掃された後の感光体ドラムの表面に、再びチャージコロトロンによって帯電が行われ、これによっ

て画像の形成を繰り返し行うことができる。光走査装置の内部には、光走査ユニット（光走査モジュール）が配置されている。この光走査ユニットは、箱体と、この箱体の内部に配置され光ビームの発生、変調および偏向を行う走査光学系とからなる。光走査ユニットから出力される光ビームは、光走査装置の内部に配置された反射ミラーのミラー面を走査する。反射ミラーによって反射される光ビームは、前記したように感光体ドラムの表面を感光体ドラムの軸方向に平行に走査することになる。この感光体ドラムの軸方向に平行な走査方向は、主走査方向と呼ばれている。感光体ドラムの表面の移動方向は、副走査方向と呼ばれている。前記走査光学系は、レーザーダイオードと、コリーメータレンズと第1のシリングレンズとポリゴンミラーとfθレンズおよび第2のシリングレンズとを有している。

【0003】 ところで、このような光走査装置を有する電子写真式画像形成装置においては、この電子写真式画像形成装置の本体の振動が光走査装置の走査光学系に伝わった場合に、光走査装置の走査光学系が振動され、バンディングを呼ばれる副走査方向に現れる画像濃度の継続のむらの発生原因となる。そこで、従来から走査光学系の振動に起因する画像濃度のむらを防止するために各種の光走査装置が提案されている。このうち特開平9-33844号公報に記載の光走査装置は、光ビームを発生する光ビーム発生器と、この光ビーム発生器から出力される光ビームを偏向する偏向器と、前記光ビームの進路に影響を与える振動を発生するおそれのある所定の振動発生部品と、この振動発生部品の本体外周と嵌合する穴部を有する支持板と、この支持板の縁部から立設するよう配置された側壁と、前記支持板と接すると共に所定の高さで前記穴部から側壁に向けて放射状に配置された複数本のリブとを有し、少なくとも前記光偏向器と振動発生部品とを収容した光学箱とを具備している。この光走査装置は、前記支持板と接すると共に所定の高さで前記穴部から側壁に向けて放射状に配置された複数本のリブによって支持板の剛性を維持して振動に起因する画像濃度のむらを防止している。従来の光走査装置においては、支持板に1つの走査光学系が配置されている場合には、前述のように支持板の剛性を維持して振動に起因する画像濃度のむらを防止することができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来の光走査装置においては、支持板（基板）に複数の光走査モジュール（光走査ユニット）が配列されている場合であって、各光走査モジュールが支持板（基板）の振動時における振動の腹または腹の近傍に配置されている場合には各走査光学系の全体が振動するから、振動に起因する画像の劣化を防止することができないという問題がある。例えば、図7に示すように、光走査装置が基板304に配列された3つの走査モジュール301、302、

303を有し、かつ、これらの光走査モジュールの偏向器（ポリゴンミラー）が曲線201で示す基板304の振動の腹に対応した部分a1, b1, c1に位置している場合には、図8に示すように各走査モジュール301、302、303の走査線305、306、307が副走査方向にずれるから各走査モジュール301、302、303の走査線305、306、307のつなぎ部がつながらなくなつて画像の劣化を引き起こすという問題がある。この各走査モジュール301、302、303の走査線305、306、307のつなぎ部がつながらなくなる画像の劣化は、基板304の振動に起因するから周期的なずれとして画像に現れるため人間の目で認識できるものである。また、各走査モジュール301、302、303の走査線305、306、307の間隔も図8に示すように不均一になつて濃度むらを発生させるという問題がある。本発明の目的は、基板に複数の走査モジュールが配列されている光走査装置において、走査モジュールの偏向器の振動を有效地に防止して画像の劣化を防止することができる光走査装置を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するためには、請求項1に記載の発明は、発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記偏向器は前記基板の振動時における振動の腹となる位置から所定距離だけ離隔した位置に配置されていることを特徴とする。請求項2に記載の発明は、発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記偏向器は前記基板の振動時における振動の節となる位置または節の近傍に配置されていることを特徴とする。請求項3に記載の発明は、発光源と、この発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向器を有する光学系とを同一の保持枠体に収容してなる複数の光走査モジュールを同一の基板の上に配列した光走査装置において、前記光走査モジュールは基板の上に相互に非対称に配列されていることを特徴とする。請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3のいずれか1つの項に記載の光走査装置において、前記光走査モジュールは同一の基板の上に光ビームの走査方向を合わせて配列していることを特徴とする。

【0006】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の1つの実施の形態に係る光走査装置を構成する走査光学系の基本的構成を示す斜視図である。図2は本発明の1つの実施の形態としての光走査装置の複数の光走査モジュールのキ

ヤップ部を外した状態を示す斜視図である。図1に示すように、本発明の光走査装置の走査光学系は、光源1とカップリングレンズ2と絞り部材3と線像結像光学系4と偏向器5とfθレンズ6と長尺レンズ7とミラー8とを有している。光源1は発散性の光束を放射する。光源1から出射された光ビームは、カップリングレンズ2を透過した後に略平行光束となり絞り部材3により光束径を規制される。絞り部材3を透過した光ビームは、副走査方向に屈折力を有する線像結像光学系4により偏向器5の偏向反射面5aの近傍に主走査方向に長い線状に結像される。偏向器5は、線像結像光学系4から入射される光ビームを等角速度的に偏向する。偏向器5からの光ビームは、fθレンズ6と長尺レンズ7およびミラー8により被走査媒体9に結像される。偏向器5の回転により光ビームが被走査媒体9において主走査方向に走査される。光源1から出射した光ビームは、カップリングレンズ2を透過した後、収束光束でも、発散光束であってもかまわない。また、光走査装置としての走査光学系は、ミラー10と、結像素子11と、同期センサ12とを有している。ミラー10は、偏向器4からの光ビームを反射して結像素子11に入射させる。結像素子11は、入射された光ビームを同期センサ12に導く。この同期センサ12と結像素子11およびミラー10は、他の走査光学系との間で走査タイミングの同期をとるためのものである。

【0007】次に、本発明の光走査装置を図2に基づいて説明する。図2に示すように、本発明の光走査装置は、回路基板104と、この回路基板104の上に主走査方向に所定距離をおいて配列されている複数の光走査モジュール（光走査ユニット）101、102、103とを有している。各光走査モジュール101、102、103は、セラミックまたはエポキシ系樹脂製の保持枠体（パッケージ）101a、102a、103aと、これらの保持枠体101a、102a、103aの各々に収容されている図1に示した光源1と、カップリングレンズ2と、絞り部材3と、線像結像光学系4と、偏向器5と、fθレンズ6と、ミラー8（偏向器5およびfθレンズ6のみが図示されている）とを有している。基板104の外側には、長尺レンズ109が回路基板104と所定距離をおいて配置されている。この長尺レンズ109は、図1の長尺レンズ7と対応するものである。光源1は、レーザーダイオードで構成されている。偏向器5は、ポリゴンミラーで構成されている。また、保持枠体101a、102a、103aには、種々の回路が収容されている。保持枠体101a～103aの側縁には、複数のリード端子111が設けられている。光源1の駆動回路（図示せず）および偏向器5の駆動回路（図示せず）は、リード端子119により保持枠体101a～103a内の前記各回路に接続されている。光走査モジュール101～103の保持枠体101a～103a

は、回路基板104上に形成された前記回路にリード端子119をハンダ付けすることにより回路基板104に固定されている。保持枠体101a～103aを回路基板104に固定する際に、感光体表面等の被走査面105における光走査モジュール101、102、103の走査線106、107、108の傾きおよび副走査方向の位置を監視しながら、保持枠体101a～103aの底面を回路基板104の上面に沿わせてθ方向およびy方向における位置決めを行って各走査線106、107、108を同一直線上に合わせる。なお、実施の形態では光走査モジュール101～103を1つの回路基板104に配列したが、光走査モジュール101～103を回路を有しない同一平面の基板に配列してもよい。例えば、光走査モジュール101～103の各々の記録幅は約80mmであり、実施の形態ではA4幅用として3つの光走査モジュール101～103が配置される。このように、実施の形態においては、1ラインを主走査方向に複数に分割して走査を行うが、必ずしも同一直線上に合わせる必要はなく、飛び越しラインの走査によりタイミング制御によって重ね合わせてもよい。

【0008】各光走査モジュール101～103から射出された光ビームは、副走査方向に集束作用があるトロイダルレンズ面を走査方向に連続して成形した長尺レンズ109を介して被走査面105にスポット状に結像される。各走査領域は若干の重なり部を有するように走査され、走査領域外の光ビームはミラー110、111、112、113により反射される。各光走査モジュール101～103の走査方向の両端には、同期センサ114、115、116、117が配置されている。これらの同期センサ114、115、116、117は、光走査モジュール101～103の走査領域の走査始端および走査終端で光ビームを検出するようにしている。光走査モジュール101～103は、それぞれ走査領域の走査始端および走査終端を検出する2個の同期センサを有するようにしてもよいが、図示した実施の形態においては隣り合った光走査モジュール101～103は走査始端と走査終端を検出する同期センサを共有するようにしている。なお、図示した実施の形態においてはミラー110、111、112、113は長尺レンズ109の直前に配置され、これにより走査範囲を規制して長尺レンズ109の隣接するレンズ面への光ビームの入射を阻止している。図3は回路基板の上に3つの光走査モジュールを主走査方向に沿って配置した光走査装置の略側面図である。図3に示すように、回路基板104は、A2部およびB2部により所定の支持部材に締結されている。光走査モジュール101～103内の各部分a2、b2、c2に偏向器5が配置されている。光走査モジュール101～103を支持した回路基板104がA2部およびB2部を支点として曲線202で示すような振動モードを有している場合に、光走査モジュール101～1

03における部分a2、b2、c2に位置する各偏向器5が回路基板104の振動時における振動の節となる位置に配置されている。この場合には、各偏向器5は回路基板104の振動の節となる位置に配置されているから、回路基板104の振動の影響をほとんど受けない。【0009】図4は、図3に示す各光走査モジュールによる被走査面における走査線の軌跡をモデル化して示す図である。図4に示すように、各光走査モジュール101～103による被走査面105における走査線106、107、108は、回路基板104の振動の影響をほとんど受けない。なお、光走査モジュール101～103は、偏向器5を回路基板104の振動時における振動の節の近傍に配置してもよく、また、偏向器5を回路基板104の振動時における振動の腹から所定距離だけ離隔した位置に配置してもよい。この場合には、偏向器5は回路基板104の振動の影響をあまり受けない。さらに、複数の光走査モジュール101～103は、回路基板104の上に相互に非対称に配列してもよい。例えば、複数の光走査モジュール101～103の隣り合う2つのものは、相互に180度だけ回転した状態で配置してもよい。この場合にも、偏向器5は振動時における振動の腹から所定距離だけ離れるから回路基板104の振動の影響をあまり受けない。図5は本体および回路基板の振動の状態を示す図である。曲線205は電子写真式画像形成装置の本体の振動モードを示している。偏向器5が起こす振動の偏向周波数と本体の振動周波数が共振する場合には曲線206で示すように回路基板104の振動の振幅は拡大する。偏向器5の偏向周波数と本体の振動周波数が互いに打ち消す場合には曲線207で示すように回路基板104の振動の振幅は小さくなる。図6は、偏向器および本体の固有振動数を示す図である。偏向器5の固有振動数はXで示す値であり、本体の固有振動数はYで示す値である。図6に示すように、偏向器5の固有振動数と本体の固有振動数とは、所定値以上だけ離す必要がある。なお、図2に示すように、複数の光走査モジュール101～103を同一の回路基板104の上に光走査線の走査方向を合わせて配置することにより、長尺レンズ109の一体化が可能となり、被走査面105と回路基板104との間にミラー110～113を配置する場合にはミラー110～113の配置が容易であり、かつ、隣り合った光走査モジュール101～103が走査線の走査始端と走査終端を検出するためのミラーを共有することができる。本発明は、プリンタ、デジタル複写機、デジタルファックスあるいはデジタル印刷機等の電子写真式画像形成装置の書込み光学系のみでなく、光走査装置を用いるあらゆる装置について適用することができる。

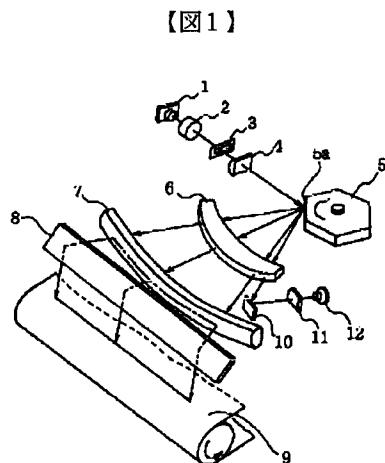
【0010】

【発明の効果】以上のように、請求項1に記載の発明は、偏向器が基板の振動時における振動の腹となる位置

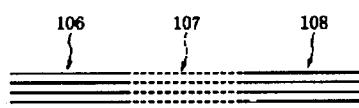
から所定距離だけ離隔した位置に配置されているから、偏向器が基板の振動の影響をあまり受けないので、バンディングを低減し、複数の光走査モジュールによる走査線のつなぎ部の副走査方向におけるずれを低減することができるため画像の劣化を防止することができる。請求項2に記載の発明は、偏向器が基板の振動時における振動の節となる位置または節の近傍に配置されているから、偏向器が基板の振動の影響をほとんど受けないので、バンディングを低減し、複数の光走査モジュールによる走査線のつなぎ部の副走査方向におけるずれを低減することができるため画像の劣化を防止することができる。請求項3に記載の発明は、光走査モジュールが基板の上に相互に非対称に配列されているから、偏向器が基板の振動の影響をあまり受けないので、バンディングを低減し、複数の光走査モジュールによる走査線のつなぎ部の副走査方向におけるずれを低減することができるため画像の劣化を防止することができる。請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3の1つに記載の光走査装置において、光走査モジュールは同一の基板の上に光ビームの走査方向を合わせて配列されているから、偏向器が基板の振動の影響をほとんど受けないので、バンディングを低減し、複数の光走査モジュールによる走査線のつなぎ部の副走査方向におけるずれを低減することができるため画像の劣化を防止することができ、かつ、光学系を容易に配置することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1つの実施の形態としての光走査装置



【図1】



の走査光学系の基本的構成を示す斜視図である。

【図2】本発明の1つの実施の形態としての光走査装置の複数の光走査モジュールのキャップ部を外した状態を示す斜視図である。

【図3】回路基板の上に3つの光走査モジュールを配置した本発明の1つの実施の形態としての光走査装置の略側面図である。

【図4】図3に示す各光走査モジュールによる被走査面における走査線の軌跡をモデル化して示す図である。

【図5】図2の光走査装置における本体および回路基板の振動の状態を示す図である。

【図6】図2の光走査装置における偏向器および本体の固有振動数を示す図である。

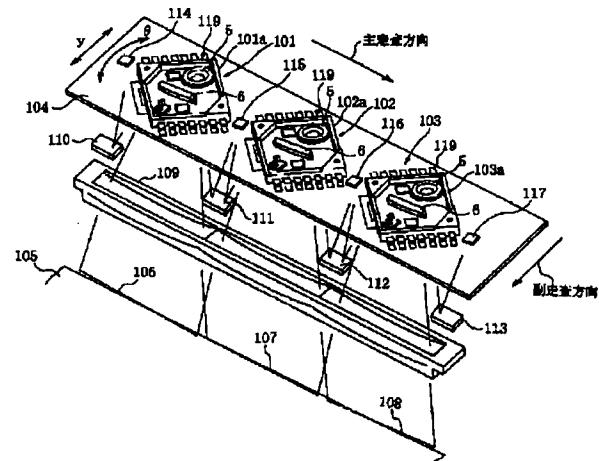
【図7】回路基板の上に3つの光走査モジュールを配置した従来の光走査装置の略側面図である。

【図8】図7に示す従来の光走査装置の各光走査モジュールによる被走査面における走査線の軌跡をモデル化して示す図である。

【符号の説明】

1 光源、2 カップリングレンズ、3 絞り部材、4 線像結像光学系、5 側向器、6 $f\theta$ レンズ、7 長尺レンズ、8 ミラー、9 被走査媒体、10 ミラ一、11 結像素子、12 同期センサ、1-1～103 光走査モジュール、104 回路基板、105 被走査面、106～108 走査線、109 長尺レンズ、110～113 ミラー、114～117 同期センサ

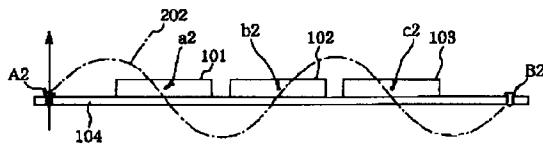
【図2】



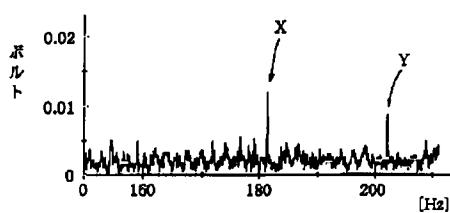
【図8】



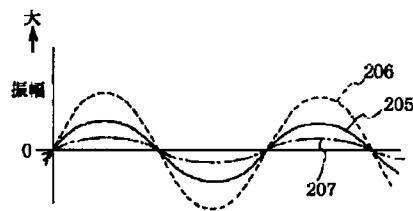
【図3】



【図6】



【図5】



【図7】

